DPP エッチングを利用したナノダイヤモンドの発光制御

Spectral control of nano-diamond by dressed photon – phonon etching

¹東京大学、²ウルム大学 [°]南雲 亮佑 ¹、F. Brandenburg ¹、八井 崇 ¹、A. Ermakova ²、F. Jelezko ²

¹Univ. Tokyo、 ²Ulm Univ. [°]R. Nagumo ¹、F. Brandenburg ¹、T. Yatsui ¹、A. Ermakova ²、F. Jelezko ²

E-mail: nagumo@nanophotonics.t.u-tokyo.ac.jp

近年,量子物理等の観点から注目を集めているのがダイヤモンドの NV センターである. NV センターとは,ダイヤモンド格子中の炭素原子の置換位置に入った窒素原子とこれに隣接する空孔から成る不純物欠陥のことである. NVセンターはダイヤモンドのバンドギャップ中に不純物準位として存在し欠陥の構造毎に固有の発光波長を持つ. 加えて,室温での電流動作の単一光子発生源としての機能や[1]優れたスピンコヒーレンス特性を持ち[2],またナノダイヤモンドと呼ばれる数十~数百 nm の微結晶はバイオマーカーとしての利用が期待されている[3].

しかし、このナノダイヤモンドは通常基板を 劈開して作るので表面の凹凸や格子欠陥が生 じてしまい、これらが非発光準位となり発光強 度を減少させていると考えられる。そこで、 DPP エッチング[4]という手法を用いてナノス ケールでの表面平滑化を行い発光強度の増加 を試みたので報告する。ただし、エッチングに よって NV センターも除去されて発光強度が 減少することも考えられるので、発光強度の時間変化を追った。

Fig. 1 に示したのは、DPP エッチング前後の ナノダイヤモンドの発光強度比の時間依存性 である. NV センターの発光波長のうち代表的 なものとして 575 nm の発光が知られており [5], その CL スペクトルを測定した. なお, DPP エッチングの際には波長 325 nm. パワー 30 mWのCWレーザを使用した.この結果より,発光強度は一度増加した後減少するという結果が得られた.発光強度の増加は,非発光の格子欠陥の除去により電子が発光準位に捉えられる確率が上がったからだと説明される.一方,発光強度の減少についてはレーザ照射によるグラファイト化[6]等も考えられるが,エッチングを2時間施した際のCL強度がバックグラウンドとほぼ同程度まで減少したことを考えると,これは表面付近のNVセンターの除去に因ると考察される.

本研究は, JSPS「研究拠点形成事業(A.先端拠点形成型)」, 旭ガラス財団研究奨励, 科研費萌芽研究の助成を得た.

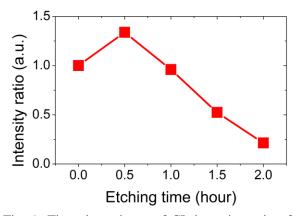


Fig. 1. Time dependence of CL intensity ratio of NV center between before and after DPP etching ($\lambda = 575$ nm).

[1] M. Mizuochi *et al*, Nature Photon. **6**, 299 (2012), [2] A. Gruber *et al*, Science **276**, 2012 (1997), [3] Chi-Chang Fu *et al*, PNAS **104**, 727 (2007), [4] T. Yatsui *et al*, Appl. Phys. B **93**, 55 (2008), [5] B. Burchard *et al*, Diamond and Related Materials **3**, 947 (1992), [6] Yu. D. Glinka *et al*, J. Phys. Chem. B **103**, 4251, (1999)